

Mikroelektronik und Mikromechanik

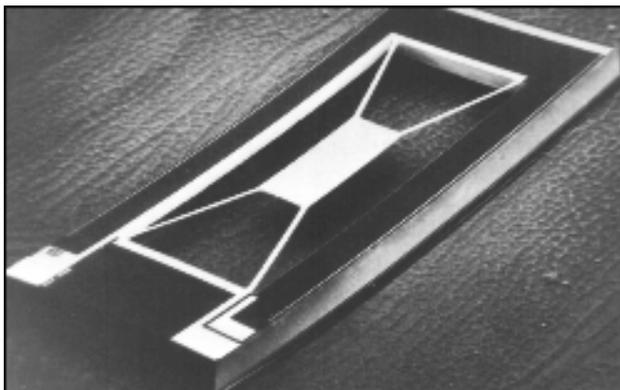
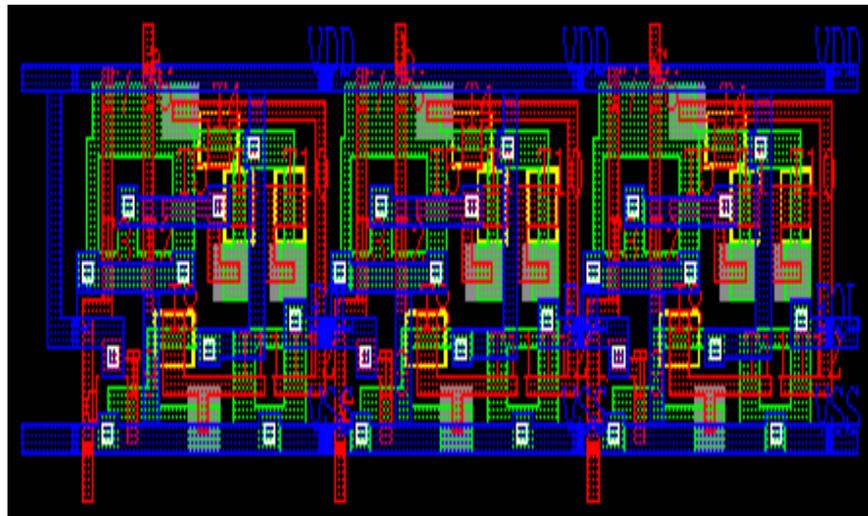
Adolf Winkler
LV 513.160



Viele Prozesse die bei der Mikroelektronik und Mikromechanik zur Anwendung kommen beruhen auf den Grundlagen der Dünnschicht- und Oberflächenphysik. In dieser Vorlesung werden die in diesem Zusammenhang stehenden Technologien vorgestellt und diskutiert.

Aus dem Inhalt:

Si-Planartechnologie
Dotieren, Ätzen, Oxidieren
Epitaxie
Lithographie
Mikromechanik
Mikrooptik
LIGA-Technik
etc.



Vorlesungsbeginn:

Donnerstag, 6. März 2003,
14:00 Uhr c.t.

Ort:

Seminarraum des Inst. für
Festkörperphysik, 1. Stock
Zi. Nr. 110